Pumpe CM5160	**Spezifikationen**
Maximaler Arbeitsdruck	60,0 MPa (0,001 – 2500 ml/min); 30,0 MPa (2501 – 5000 ml/min)
Flussrate	0,001 bis 5000 ml/min
Richtigkeit der Flussrate	±2 µl/min (0,01 - 0,1 ml/min); ±1% (0,101 – 2,5 ml/min)
Genauigkeit der Flussrate	0,075% RSD
Optionales Zubehör	6-Kanal-Degasser; 4-Kanal-Niederdruckgradient; zusätzliche Hinterkolbenspülung; Tastatur
Pumpe CM5110	**Spezifikationen**
Maximaler Arbeitsdruck	40,0 MPa (0,001 – 5000 ml/min); 20,0 MPa (5001 – 9999 ml/min)
Flussrate	0,001 bis 9999 ml/min
Richtigkeit der Flussrate	±2 µl/min (0,01 - 0,1 ml/min); ±1% (0,101 - 5 ml/min)
Genauigkeit der Flussrate	0,075% RSD
Optionales Zubehör	6-Kanal-Degasser; 4-Kanal-Niederdruckgradient; zusätzliche Hinterkolbenspülung; Tastatur
Autom. Probengeber CM5260	**Spezifikationen**
Propenkapazität	120 (1,5 ml); 72 (4 ml) (Option); 195 (1 ml) (Option); 192 (96-holes microplate x 2) (Option); 768 (384-holes microplate x 2) (Option)
Injektionsmethode	Cut - Injektionsmethode; All volume - Injektionsmethode; Full loop - Injektionsmethode
Spritzenvolumen	175 µl (Standard); 70 µl (Option); 700 µl (Option); 3,5 ml (Option)
Reproduzierbarkeit des Injektionsvolumens	≤0,2% RSD (mit 10 µl Injektion, Cut-Injektionsmethode); ≤1,0% RSD (mit 1 µl Injektion, All volume- Injektionsmethode); ≤0,2% RSD (mit 5 µl Injektion, Full loop- Injektionsmethode)
Verschleppung	≤0,003 % (Cut- Injektionsmethode)
Linearität des Injektionsvolumens	Korrelationskoeffizient: ≥0,999 (Cut- Injektionsmethode)
Injektionsvolumengenauigkeit	±2%
Minimale Injektionszeit	ca. 28 s
Thermostat (Option)	1 bis 45 °C (in 1 °C Schritten)
Optionales Zubehör	Tastatur
Autom. Probengeber CM5280	**Spezifikationen**
Propenkapazität	200 (1,5 ml); 128 (4 ml) (Option); 288 (96-holes microplate x 3) (Option); 1152 (384-holes microplate x 3) (option)
Injektionsmethode	Direct-Injektionsmethode
Spritzenvolumen	100 µl (Standard); 500 µl (Option); 1 ml (Option)
Reproduzierbarkeit des Injektionsvolumens	≤0,3% RSD (bei 10µl Injektion)
Verschleppung	≤0,003%
Linearität des Injektionsvolumens	Korrelationskoeffizient: ≥0,999 (Cut-Injektionsmethode)
Injektionsvolumengenauigkeit	±2%
Minimale Injektionszeit	ca. 28 s
Thermostat (Option)	1 bis 35 °C (in 1 °C Schritten)
Optionales Zubehör	Tastatur
Säulenofen CM5310	**Spezifikationen**
Arbeitstemperatur	1 bis 85 °C (in 1 °C Schritten)
Temperaturgenauigkeit	±1,0 °C (20 bis 85 °C mit Vorheizung)
Temperaturpräzision	SD ≤0,2 °C
Säulenkapazizäz	300 mm Säulen x 3 Stück
Verfügbare-Ventile	3-fach Säulenselektionsventil (max. 350 bar); 6-Weg-2-Positionen Ventil (max. 350 bar); 6-Weg-2-Positionen Ventil (max. 600 bar)
Optionales Zubehör	Tastatur
Säulenofen CM6310	**Spezifikationen**
Arbeitstemperatur	4 bis 90 °C (in 1 °C Schritten)
Temperaturgenauigkeit	±0,5 °C (20 bis 85 °C mit Vorheizung)
Temperaturpräzision	SD ≤ 0,1 °C
Säulenkapazizäz	300 mm Säulen x 3 Stück; 6 x (100mm x 6 oder 50 x 3, 100mm x 3)
Verfügbare-Ventile	6-fach-Säulenselektionsventil (max. 1200 bar)
UV-Detektor CM5410	**Spezifikationen**
Optisches Messprinzip	Doppelstrahlmessung
Lichtquelle	D2 Lampe
Messbereich	190 bis 600 nm
Messmethode	1-Wellenlänge und duale 2-Wellnlängenmessung
Spectrale Bandbreite	6 nm
Wellenlängengenauigkeit	±1 nm
Rauschen	0,5 × 10-5 AU oder weniger
Driften	1,0 × 10-4 AU oder weniger
Flusszelle	Quartz, SUS, Fluororesin (Optische Weglänge 10 mm, Zellenkapazität 13 µl)
Druckresistenz der Flusszelle	1,0 MPa
Optionales Zubehör	Tastatur; therm. Zelle
UV-Vis-Detektor CM5420	**Spezifikationen**
Optisches Messprinzip	Doppelstrahlmessung
Lichtquelle	D2 Lampe & W Lampe
Messbereich	190 bis 900 nm
Messmethode	1-Wellenlänge und duale 2-Wellnlängenmessung
Spectrale Bandbreite	6 nm
Wellenlängengenauigkeit	±1 nm
Rauschen	0,5 × 10-5 AU oder weniger
Driften	1,0 × 10-4 oder weniger
Flusszelle	Quartz, SUS, Fluororesin (Optische Weglänge 10 mm, Zellenkapazität 13 µl)
Druckresistenz der Flusszelle	1,0 MPa
Optionales Zubehör	Tastatur; therm. Zelle

DAD-Detector CM5430	Spezifikationen
Optisches Messprinzip	Photometrische Einfachstrahlmessung
Lichtquelle	D2 Lampe, W Lampe Hg Lampe (für Wellenlängencheck)
Messbereich	190 bis 900 nm (D2 und W Betrieb)
Messmethode	Spektrum
Wellenlängengenauigkeit	±1 nm
Rauschen	0,5 × 10-5 AU oder weniger
Driften	0,4 × 10-3 AU oder weniger
Flusszelle	Quartz, SUS, Fluororesin (Optische Weglänge 10 mm, Zellenkapazität 13 µl)
Druckresistenz der Flusszelle	1,0 MPa
Optionales Zubehör	therm. Zelle
FL-Detektor CM5440	**Spezifikationen**
Optisches Messprinzip	Verhältnisphotometrie
Lichtquelle	Xe Lampe (150 W) & Hg Lampe (für Wellenlängencheck)
Excitation Wellenlängenbereich	200 bis 850 nm
Emission Wellenlängenbereich	250 bis 900 nm
Spectrale Bandbreite	15 nm
Wellenlängengenauigkeit	±3 nm
Sensitivität (15 nm slit)	S/N Verhältnis des Wasser-Raman-Peaks: 700 oder mehr (Basislinien Methode); S/N Verhältnis des Wasser-Raman-Peaks: 525 oder mehr (Tangentiale-Methode)
Sensitivität (30 nm slit)	S/N Verhältnis des Wasser-Raman-Peaks: 900 oder mehr (Basislinien Methode)
Flusszelle	12 µl
Druckresistenz der Flusszelle	1,0 MPa
RI-Detektor CM5450	**Spezifikationen**
Optisches Messprinzip	Deflektion
Lichtquelle	Tungsten Lampe
Messbereich	1,0 bis 1,75
Linearität	600 µRIU oder mehr
Rauschen	2,5 nRIU oder weniger
Driften	0,2 µRIU/h oder weniger
Flusszelle	Quartz
Druckresistenz der Flusszelle	2 bar